

# 透射式电子显微镜TEM测试分析，形貌结构

产品名称	透射式电子显微镜TEM测试分析，形貌结构
公司名称	深圳市启威测标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道甘李五路1号科伦特研发楼附属楼101（启威测实验室）
联系电话	0755-27403650 13631643024

## 产品详情

透射式电子显微镜TEM测试分析，用于纳米载药颗粒和纳米诊断探针等纳米材料的尺寸、形貌、结构和成分分析。

透射式电子显微镜设备参数如下：设备型号：FEI Tecnai G2 F20 S-Twin

技术指标：

点分辨率 0.24nm

线分辨率 0.102nm

信息分辨率 0.14nm

加速电压：20kV-200kV；加速电压连续可调

放大倍数：最小25倍，最大 1,000,000倍

能谱仪(EDS)：分辨率优于136eV (Mn Ka线)

分析元素范围：B5-U92

扫描透射(STEM)：分辨率 0.19 nm

放大倍数范围150x - 230Mx

数字化CCD照相系统：感应尺寸：4k × 2.7k像素

像素大小 9um × 9um ; 动态范围 14-bit

测试须知：

以下情况样品,拒绝进行测试:

- 1、铜网请使用200目或以上；测试中若发现碳膜破坏严重,将立即取出样品,以防止污染电镜；
- 2、测试样品颗粒一般应小于1um,测试中若发现颗粒过大易于脱落，须马上取出样品,避免掉落,防止污染电镜；
- 3、磁性样品会对电镜的电磁透镜造成永久伤害,本电镜拒绝测试；
- 4、低熔点样品(如铟、锡等)，会产生相变,其蒸气污染电镜,本电镜拒绝测试；
- 5、高聚物裂解温度需高于350，测试时请附上TGA曲线图,否则拒绝测试；
- 6、对于有毒、易挥发、腐蚀性和放射性样品,本电镜拒绝测试；